

Errata

T. Magn. Soc. Jpn. (Special Issues)., 4, 16-20 (2020)
反応性パルス DC スパッタリング成膜における
 BiFeO_3 系強磁性・強誘電薄膜の高品位作製の指針
武田航太朗・山本大地・吉村哲

訂正箇所 1

ページ番号 : page 19

訂正箇所 : Fig. 4 の縦軸タイトル

[Error] : Saturation magnetization

[Correct] : Magnetization

訂正箇所 2

ページ番号 : page 19

訂正箇所 : Fig. 5 の縦軸タイトル

[Error] : Saturation magnetization

[Correct] : Magnetization